## 科学研究費助成事業

\_\_\_\_



平成 2 8 年 5 月 3 0 日現在

研究成果報告書

研究課題名(和文)コヒーレント軟X線を用いた高空間・高時間分解顕微干渉イメージングシステムの開発

研究課題名(英文)Development of high spatial and temporal resolusion interference imaging system by using coherent soft x-ray

研究代表者

機関番号: 16101

研究期間: 2013~2015 課題番号: 25286086

研究種目:基盤研究(B)(一般)

富田 卓朗(Tomita, Takuro)

徳島大学・ソシオテクノサイエンス研究部・准教授

研究者番号:90359547

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 13,400,000円

研究成果の概要(和文): フェムト秒レーザー照射によって起こるナノメートルレベルでの微細な加工現象を明らか にするため、フェムト秒レーザーポンプ・軟X線プロープの時間分解イメージングシステムの構築を行った。反射率イ メージングからはレーザー加工によって生じる剥離薄膜の膨張過程を明らかにすることができ、膨張途中の剥離薄膜の 形状が入射レーザー光の強度プロファイルに一致することを明らかにした。 さらに、軟X線の干渉計測も行うことで、レーザー照射直後の1ナノ秒以下で生じる剥離薄膜の形成とアプレーション 痕の形成過程も明らかにすることが出来た。

研究成果の概要(英文): In order to discuss the nanometer-scaled precise ablation phenomena induced by femtosecond laser irradiation, we constructed the femtosecond laser pump and the soft x-ray probe time resolved imaging system. From the reflective imaging, we succeed to reveal the expansion process of the exfoliated film associated with the femtosecond laser ablation. In addition, it has found that the vertical shape of the exfoliated films is similar to the intensity profile of the incident laser beam used for the laser ablation.

Moreover, by using the soft x-ray interferometry, the formation process of the exfoliated film that has formed within less than one nanosecond, and the formation process of the ablation crater has successfully observed.

研究分野:光物質科学

キーワード: 軟X線レーザー 顕微計測 時間分解測定 フェムト秒レーザーアブレーション シングルショット計測

## 1. 研究開始当初の背景

高強度のレーザー光を物質に照射すると、 物質を構成している元素が原子や分子となり 飛散・改質されることで、物質が加工される。 特に、10兆分の1秒程度の短い時間フラッシ ュのように点滅するフェムト秒レーザーを照 射した場合、照射したレーザー光の波長を下 回る周期的な凹凸構造の自発的形成や1ショ ットあたり1原子層分の厚さを遥かに下回る 掘削現象などの特異な現象が観察される。こ れらの現象は微細加工技術が必要とされるマ イクロ・ナノ構造の製造分野や眼科手術など の医療分野にもフェムト秒レーザーを用いた レーシック技術として応用が開始されている。 しかし、これらの加工過程の詳細は明らかに なっていないため、その潜在能力が明らかに なっておらず、フェムト秒レーザー照射によ る加工過程の正確な理解がその応用展開の上 で非常に重要となってきている。

そこで本研究では、フェムト秒レーザー特 有の微細加工現象を明らかにするため、波長 13.9 nmのプラズマ軟X線レーザーを用いた 反射率計測および干渉計測により、フェムト 秒レーザー照射による加工の基礎過程解明を 目指した。プローブ光に可視光よりも遥かに 短波長の電磁波である軟X線を用いることで 高い空間分解能での観測が可能となり、試料 の時間精度で計測した。さらに、軟X線は侵 入長も浅いため、フェムト秒レーザーによる 加工現象のような表面現象を観測する上で最 適である。

## 2. 研究の目的

(1) フェムト秒レーザーポンプ・軟 X 線レー ザー反射率プローブによって、フェムト秒レ ーザー照射後の剥離薄膜の時間変化を観察す る。

(2) フェムト秒レーザーポンプ・軟 X 線レー ザー干渉プローブを用いて、フェムト秒レー ザー照射後の試料表面の時間変化を観察する。

(3) 上記の計測の時間分解能を高めるため、フ エムト秒レーザーパルスと軟X線レーザーパ ルスのタイミング評価システムを構築する。

3. 研究の方法

(1) フェムト秒レーザーポンプ・軟 X 線レー ザープローブ計測の光学系を構築し、プロー ブ光の試料からの反射率を測定することで、 フェムト秒レーザー照射による加工過程の観 察を行った。ポンププローブ計測とは、ポン プ光(試料表面に変化を引き起こす光)が試料 に照射されてから、プローブ光(観察光)が試料 に照射されるまでの現象を捉えるもので、特 に電気的手法では計測が困難なナノ秒程度以 下の時間間隔を計測するうえで有用な手法で ある。具体的には、ポンプ光もしくはプロー ブ光の光路長を変化させることで、光の到達 時間を変化させることにより、ポンプ光の照 射部の時間変化を測定する測定方法のことで ある。

(2)(1)の光学系に、2枚の鏡を同一平面上から ごく僅かに角度をつけたダブルロイズ鏡と呼 ばれる光学素子を組み込むことで CCD 上に プローブ光の干渉縞を発生させる。この干渉 計測によりフェムト秒レーザー照射による加 工過程、特に、フェムト秒レーザー加工過程 初期における表面の微小変位を観察した。

(3) 上記の計測中にポンプ光とプローブ光の 一部をそれぞれ分離する光学系を構築した。 この分離した光を利用し、フェムト秒レーザ ーパルスと軟X線レーザーパルスをストリー クカメラに取り込むことで、反射率や干渉計 測の観測中にピコ秒の精度でのレーザーパル ス間のタイミング揺らぎを評価することを可 能にした。

4. 研究成果

(1) 剥離薄膜形状の観察:図1のような光学系 を構築し、ポンププローブ法の反射率計測に よってフェムト秒レーザー光を金属薄膜(タ ングステン、金、白金)に照射することによっ て生じる剥離薄膜の観察を行った。試料の金 属薄膜は表面の平坦性を確保するため、石英 基板等に蒸着を行って作製した。蒸着した金 属薄膜の厚さは100 nm から113 nm であった



図1:反射率計測の実験装置概略図



図 2: タングステンにフェムト秒レーザー 光を照射した際における反射率像 の時間発展

が、本研究で議論する剥離薄膜の厚さは 10 nm 程度であるため、実際にはバルクの金属材料 の加工過程を観察しているものと等価である と考えられる。

図2に反射率像の時間発展を示す。像の左 上の数字はフェムト秒レーザーが照射されて からの時間を示している。t=∞では、レーザー 照射によって試料表面に凹凸が生じているこ とを示している。この凹凸が形成されるまで の時間帯で大きく二つの特徴的な反射率像が 得られた。フェムト秒レーザー照射後 100 ピ コ秒から 300 ピコ秒程度の時間帯において t=175 ピコ秒のようなニュートンリング、50 ナ ノ秒から 300 ナノ秒程度の時間帯において t=100 ナノ秒のときと同じような楕円形の低 反射率部が観察できた。

現在、加工過程は光散乱や可視光イメージ ングなどの先行研究によってある程度体系付 けられており、飛散物は薄膜となり飛散する ことが知られている。ニュートンリングはこ の薄膜で反射した軟 X 線と試料表面つまり、 加工された凹部の底面で反射した軟X線との 干渉によって発生したと考えられる。この結 果は、これまであらゆる状況下で観測されて きたニュートンリングの中で最も短波長の電 磁波領域におけるニュートンリングの観察に 成功したことになる。

その後、この薄膜は数十ナノ秒間膨張を続 け、レーザー照射部の外側で反射していた軟 X線を遮る高さになると、その影が現れ、 t=100 ナノ秒のときのような楕円形の低反射 率部が発生した。この t=100 ナノ秒のときの ような反射率像から、その影の形状と、軟X 線の入射角を考慮することで実際の剥離薄膜 の形状が求められる。図3にこの方法によっ て求めた剥離薄膜形状の時間発展を示す。 のグラフから、剥離薄膜の形状はガウス型関 数の形状をしており、加工に用いたフェムト 秒レーザー光の強度分布、つまりガウス型の 強度分布と相似との関係にあることが明らか になった。このことから、レーザー照射によ って生じる薄膜の形状はレーザーの強度分布 により制御できるといえる。この成果は本研 究によって初めて明らかになったものであり、 この結果から剥離薄膜の形状は加工に用いる レーザーの強度分布によって精密に制御でき



ることがわかった。さらに、この結果を利用 することでフェムト秒レーザー加工における 飛散物(デブリ)の低減や制御に繋がることも 期待できる。

(2) 試料表面形状の観察:

図4のように(1)の実験装置にダブルロイズ 鏡を組み込み、干渉計測を行った。ダブルロ イズ鏡とは二枚の鏡を微小な角度だけずらす ことによって、1枚目の鏡で反射した軟X線 と2枚目の鏡で反射した軟X線との間に光路 差を作り、干渉縞を発生させる素子のことで ある。



図4:干渉計測装置の概略図

この実験によって得られた干渉像を図5に 示す。この縦縞の干渉像において、干渉縞が 直線の部分は試料表面が平坦であることを示 し、左側ヘシフトしていることは試料表面が 表面から膨張していることに対応している。 右側へのシフトは試料表面がへこんでいるこ とを示している。図5より、t=19 ピコ秒でフ ェムト秒レーザー照射部の中央付近が左方向 にシフトし、t=71 ピコ秒でそのシフト量が増 加していることがわかる。その後、t=260 ピコ 秒では t=∞と同じように黒い円盤の淵付近で 左側へ、中央付近で右側へシフトしているこ とがわかる。このように軟X線の干渉計測を 用いることで、フェムト秒レーザー光照射直 後の表面形状の変化をプラズマ等の影響を受 けることなく観測することができた。

この干渉像を解析することによって、表面 形状を三次元像に復元することができ、復元 された形状が図6のようになる。図6から、 フェムト秒レーザー照射後、試料表面は一度



図5:タングステンにフェムト秒レーザー を照射した際における干渉像の時間発展



図6:試料表面形状の時間発展

膨張した後にへこんでいくことを見出した。 この結果から反射率像によって得られた剥離 薄膜の持続的な膨張とは対照的に試料表面は 比較的早い時間帯からへこみはじめることが 明らかになった。

(3) タイミング計測システムの構築:(1)と(2) の計測からもわかるように、フェムト秒レー ザー照射によって生じる現象はピコ秒からナ ノ秒領域で起こる高速な現象である。この計 測には、ポンプ光とプローブ光の照射タイミ ングをピコ秒の精度で正確に計測するシステ ムが必要となる。そこで我々は、図7のよう なタイミング計測システムを構築し、ストリ ークカメラによってポンプ光とプローブ光の 時間差を測定した。

まず、赤と紫で示した光を同時にストリー クカメラに取り込むようにポンプ光とプロー ブ光の光路を構築した。次に、ポンプ光とプ ローブ光をそれぞれ分離した光(橙と緑)の時 間差を計測する。この橙と緑の時間差が t=0 の ときの時間差となる。

この時間差がわかることにより、ポンプ光 とプローブ光に光路差を発生させてストリー クカメラで得られた時間差から橙と緑の時間



図7:ポンプ光とプローブ光のタイミグ計測 システム

差を差し引くことで、試料でのポンプ光とプ ローブ光の時間差を得ることができる。

以上のようにポンプ光とプローブ光のタイ ミングを計測するシステムを構築した。この 計測システムは前述した反射率計測や干渉計 測にも用いられている。さらに、この手法は 国内外の他の軟X線光源を用いた時間分解計 測にも適用可能な汎用的な手法である。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計4件)

① N. Kakimoto, T. Eyama, R. Izutsu and <u>T.</u> <u>Tomita</u>, The Shape of The Exfoliated Surface during Femtosecond Laser Ablation, Journal of Laser Micro/Nanoengineering (査読有), Vol. 11, pp. 91-94, 2016

DOI: 10.2961/jlmn.2016.01.0017

② M. Baba, <u>M. Nishikino, N. Hasegawa, T. Tomita</u>, Y. Minami, R. Takei, M. Yamagiwa, <u>T. Kawachi</u> and <u>T. Suemoto</u>, Submicron scale image observation with a grazing incidence reflection-type single-shot soft X-ray microscope, Japanese Journal of Applied Physics (査読有), Vol. 53, pp.080302 (1-4), 2014

DOI: 10.7567/JJAP.53.080302

③ <u>T. Tomita</u>, <u>M. Nishikino</u>, <u>N. Hasegawa</u>, Y. Minami, R. Takei, M. Baba, T. Eyama, S. Takayoshi, T. Kaihori, T. Morita, Y. Hirano, <u>T. Kawachi</u>, M. Yamagiwa and <u>T. Suemoto</u>, Time-resolved soft x-ray imaging of femtosecond laser ablation processes on metals, Journal of Laser Micro/Nanoengineering (査読有), Vol.9, pp. 137-142, 2014.

DOI: 10.2961/jlmn.2014.02.0011

 ④ <u>富田</u> 卓朗、固体物性からみたレーザーア ブレーション,講座:レーザー生成プラズマの 新しい温度,密度領域における物性とシミュ レーション,プラズマ・核融合学会誌、査読有、 Vol. 89、2013 年、493-499 頁 URL: http://ci.nii.ac.jp/naid/110009636051/

## 〔学会発表〕(計 32 件)

①江山 剛史、柿本 直也、井筒 類、<u>富田 卓</u> <u>朗、長谷川 登、錦野 将元</u>、南 康夫、馬場 基 芳、<u>河内 哲哉</u>、山極 満、<u>末元 徹</u>、金属のフ ェムト秒レーザーアブレーション過程におけ る剥離形状と照射強度分布の相関、日本物理 学会第 70 回年次大会、2015 年 3 月 23 日、早 稲田大学早稲田キャンパス(東京都・新宿区)

② 柿本 直也、江山 剛史、井筒 類、<u>富田 卓</u> <u>朝、長谷川 登、錦野 将元</u>、南 康夫、馬場 基 芳、<u>河内 哲哉</u>、山極 満、<u>末元 徹</u>、軟 X 線シ ャドウグラフを用いたフェムト秒レーザー照 射によるタングステンの剥離薄膜形状の観測、 日本物理学会第 70 回年次大会、2015 年 3 月 22日、早稲田大学早稲田キャンパス(東京都・ 新宿区)

③ <u>T. Tomita</u>, Single-shot soft x-ray imaging for the understanding of femtosecond-laser induced nano-periodic structure formation process, The 15th Symposium on Advanced Photon Research, 13th Nov. 2014, Japan Atomic Energy Agency (Kyoto • Kizugawa-shi)

④ N. Kakimoto, T. Eyama, <u>T. Tomita, N. Hasegawa, M. Nishikino</u>, Y. Minami, R. Takei, M. Baba, T. Kaihori, T. Morita, Y. Hirano, <u>T. Kawachi</u>, M. Yamagiwa and <u>T. Suemoto</u>, Observation of femtosecond laser ablation process in nanoseconds region by soft x-ray shadow graph, 9th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications, KUNIBIKI MESSE (Shimane Prefectural Convention Center), 1st Oct. 2014, (Shimane • Matsue)

(5) <u>T. Tomita, N. Hasegawa, M. Nishikino, T. Eyama, Y. Minami, R. Takei, M. Baba, T. Kaihori, T. Morita, Y. Hirano, T. Kawachi, M. Yamagiwa and T. Suemoto, Observation of the transient state of the femtosecond laser ablation phenomena on various metals, 8th International Conference on Reactive Plasmas 31st Symposium on Plasma Processing, 6th Feb. 2014, Fukuoka Convention Center, (Fukuoka • Fukuoka),</u>

〔その他〕 研究室ホームページ https://cms-ldap.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/ person/S10703/WEB/index.html

6. 研究組織

(1)研究代表者
富田 卓朗(TOMITA, Takuro)
徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス
研究部・准教授
研究者番号:90359547

 (2)研究分担者 長谷川登(HASEGAWA, Noboru) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・ 量子ビーム応用研究部門・研究職 研究者番号:50360409 (平成27年度より削除)

錦野 将元(NISHIKINO, Masaharu) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・ 量子ビーム応用研究部門・研究副主幹 研究者番号:70370450 (平成 27 年度より削除) 河内 哲哉 (KAWACHI, Tetsuya) 独立行政法人日本原子力研究開発機構・ 量子ビーム応用研究部門・研究主幹 研究者番号:40343941 (平成 27 年度より削除)

末元 徹 (SUEMOTO, Tohru) 東京大学・物性研究所・教授 研究者番号:50134052 (平成 27 年度より削除)

大西 直文(OHNISHI, Naofumi) 東北大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:20333859 (平成 27 年度より削除)

(3)研究協力者
江山 剛史(EYAMA, Takashi)
柿本 直也(KAKIMOTO, Naoya)
井筒 類 (IZUTSU, Rui)